

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 特許公報(B2)

(11) 特許番号

特許第4411158号
(P4411158)

(45) 発行日 平成22年2月10日(2010.2.10)

(24) 登録日 平成21年11月20日(2009.11.20)

(51) Int.Cl.	F 1
H01L 21/027 (2006.01)	H01L 21/30 515 F
G03F 7/20 (2006.01)	G03F 7/20 521
H01L 21/683 (2006.01)	H01L 21/68 P
	H01L 21/68 R

請求項の数 7 (全 10 頁)

(21) 出願番号 特願2004-221127 (P2004-221127)
 (22) 出願日 平成16年7月29日 (2004.7.29)
 (65) 公開番号 特開2006-41302 (P2006-41302A)
 (43) 公開日 平成18年2月9日 (2006.2.9)
 審査請求日 平成19年7月27日 (2007.7.27)

(73) 特許権者 000001007
 キヤノン株式会社
 東京都大田区下丸子3丁目30番2号
 (74) 代理人 100090538
 弁理士 西山 恵三
 (74) 代理人 100096965
 弁理士 内尾 裕一
 (72) 発明者 宮島 義一
 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キ
 ヤノン株式会社内
 (72) 発明者 藤原 康裕
 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キ
 ヤノン株式会社内
 審査官 岩本 勉

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】露光装置

(57) 【特許請求の範囲】

【請求項 1】

原版面に描かれたパターンを、投影光学系を介して基板に投影転写する露光装置において、

前記原版を保持し移動させる原版ステージを備え、

前記原版ステージは、前記原版ステージの移動方向に沿う複数の箇所で前記原版に当接し保持位置決めする原版保持面が設けられた第1の原版保持部位と、前記第1の原版保持部位の原版保持面に対して異なる位置で前記原版に当接し保持する原版保持面とピンとが設けられた第2の原版保持部位とを備え、

前記第1の原版保持部位および前記第2の原版保持部位の少なくともいずれかに真空吸引手段が設けられ、

前記第2の原版保持部位は、前記第1の原版保持部位に対して前記原版ステージの移動方向に延びて連続的に構成され、前記第2の原版保持部位の原版保持面およびピンは前記第1の原版保持部位の原版保持面に対して鉛直方向に変位可能であることを特徴とする露光装置。

【請求項 2】

前記第1および第2の原版保持部位は一体構造であり、

前記第2の原版保持部位の原版保持面の鉛直方向の厚さが前記第1の原版保持部位の原版保持面の鉛直方向の厚さよりも薄いことを特徴とする請求項1に記載の露光装置。

【請求項 3】

10

20

前記第2の原版保持部位は、前記第1の原版保持部位に対して前記原版ステージの移動方向側のみに設けられていることを特徴とする請求項1または2に記載の露光装置。

【請求項4】

前記第2の原版保持部位は、該原版面の位置決め計測手段の計測光透過孔が設けられていることを特徴とする請求項1～3のいずれか1項に記載の露光装置。

【請求項5】

前記第2の原版保持部位の原版保持面に真空吸引溝を有し、

前記ピンは前記真空吸引溝に設けられていることを特徴とする請求項1～4のいずれか1項に記載の露光装置。

【請求項6】

原版に描かれたパターンを、投影光学系を介して基板に投影転写する走査露光装置において、

走査方向に沿う複数箇所で前記原版に当接する第1の原版保持面を有し、前記原版を前記投影光学系の光軸方向に位置決めする第1の原版保持部位と、

前記第1の原版保持面の複数箇所間に於いて前記原版に当接する第2の原版保持面と、吸着溝と、前記吸着溝の内部に形成され前記第2の原版保持面とは異なる位置で前記原版に当接するピンとを有する第2の原版保持部位と、

前記吸着溝の内部の空間を排気する真空吸引手段とを備え、

前記第2の原版保持面および前記ピンが前記第1の原版保持面に対して、前記光軸方向に変位可能に構成されることを特徴とする露光装置。

10

20

【請求項7】

請求項1～6のいずれかに記載の露光装置を用いて露光対象に露光を行う工程と、露光された前記露光対象を現像する工程と、を具備することを特徴とするデバイス製造方法。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

本発明は、半導体製造工程において用いられ、レチクルパターンをシリコンウエハ上に投影して転写する露光装置に関するものであって、レチクル(原版)の保持手段に関する。

【背景技術】

30

【0002】

従来例を図10～図12に示す。ここで、101はレチクルであって露光パターンの原版であり、102は、レチクルステージであって、レチクル101を搭載し、露光光に対してレチクル101をスキャン露光させる。103は、レチクルクランプであって、レチクル101を、レチクルステージ102にクランプする手段である。

【0003】

104は、縮小投影レンズであって、レチクル101上のパターンを、シリコン基板より成るウエハ105上に縮小投影する。106は、ウエハステージであって、ウエハ105を搭載し、図11に示すように、前記レチクルステージ102と同期して、露光光に対してスキャン移動し露光する。

40

【0004】

以上、従来構成で図12に示す様に、レチクル101を、レチクルクランプ103にクランプする際、レチクルクランプ103には、レチクルクランプパッド103Aが構成され、レチクルクランプパッド103Aをバキュームパッドにすることにより、レチクル101を真空吸引クランプする。

【0005】

その際、図12(2)に示すように、レチクルクランプパッド103Aの上面クランプ面に、異物103Bが付着した場合、レチクル面上のパターンをウエハ上に投影する際に、パターン面内デフォーカスの悪化及びウエハ上パターン精度の悪化が発生するという問題があった。また、レチクル101の面と4箇所のレチクルクランプパッド103Aの構

50

成する面との間の平坦度差から、レチクル 101 の面をクランプ時に変形歪ませることがあった。

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

【0006】

本発明では、上記従来例に示す様に、レチクル面とレチクルクランプ面との間の平坦度差から、レチクルクランプ時のレチクルへの歪みの発生を防ぐことが課題である。

また、同じくクランプ面に付着した異物によるレチクルへの歪みの発生を抑えることが課題である。

【0007】

そこで、本発明は、レチクルなどの原版クランプ時の原版面への歪の発生を防ぎ、原版を歪ませることなく露光可能な露光装置を提供することを目的とする。

【課題を解決するための手段】

【0008】

上記目的を達成するために、本発明は、原版面に描かれたパターンを、投影光学系を介して基板に投影転写する露光装置において、前記原版を保持し移動させる原版ステージを備え、前記原版ステージは、前記原版ステージの移動方向に沿う複数の箇所で前記原版に当接し保持位置決めする原版保持面が設けられた第1の原版保持部位と、前記第1の原版保持部位の原版保持面に対して異なる位置で前記原版に当接し保持する原版保持面とピンとが設けられた第2の原版保持部位とを備え、前記第1の原版保持部位および前記第2の原版保持部位の少なくともいずれかに真空吸引手段が設けられ、前記第2の原版保持部位は、前記第1の原版保持部位に対して前記原版ステージの移動方向に延びて連続的に構成され、前記第2の原版保持部位の原版保持面およびピンは前記第1の原版保持部位の原版保持面に対して鉛直方向に変位可能であることを特徴とする露光装置。

【0009】

つまり、本発明では、原版面と原版保持面の間の平坦度差が生じた際や、原版面と原版保持面の間に異物が付着した際に、保持面を位置決めする原版保持部材の原版保持面を、第1の原版保持部位と、保持面に対して吸引力を発生させながら異物や原版面の状態に対して、弾性変形しながら沿わすことにより吸引クランプする第2の原版保持面とを設けることにより、異物及び原版面と原版保持面間の平坦度の差による原版面への歪の発生を防ぐ。

【0010】

また、本発明は、前記第1の原版保持部位及び前記第2の原版保持部位の少なくともいずれかの原版保持面上に、真空吸引手段または静電吸引手段が設けられていることを特徴としてもよく、前記第1の原版保持部位と前記第2の原版保持部位は、該原版を保持する際に、両者の該原版保持部位の該原版保持面が該原版に当接することを特徴としてもよく、前記第2の原版保持部位の該原版保持面の真空吸引溝に原版面と部分当接する部位を複数箇所設けたことを特徴としてもよい。

【0011】

また、本発明では、前記第2の原版保持部位は、該原版面に対して略鉛直方向に弾性変位可能であることを特徴としてもよく、前記第2の原版保持部位は、前記第1の原版保持部位の外周部に設けられていることを特徴としてもよく、複数の前記第1の原版保持部位間に前記第2の原版保持部位が一体的に設けられていることを特徴としてもよく、前記第2の原版保持部位は、該原版面の位置決め計測手段の計測光透過孔が設けられていることを特徴としてもよく、前記第2の原版保持部位は、複数の分割体を備えてなり、各分割体の原版保持面が該原版に対して独立して変位可能なことが好ましい。

【0012】

また、本発明は、上記いずれかの露光装置を用いて露光対象に露光を行う工程と、露光された前記露光対象を現像する工程と、を具備することを特徴とするデバイス製造方法にも適用される。

10

20

30

40

50

【発明の効果】**【0013】**

本発明では、原版保持部への異物付着及び原版面と原版保持面間の平坦度の差による原版面への歪の発生を防ぎ、原版を歪ませることなく露光可能な露光装置を提供することができるという効果がある。

【発明を実施するための最良の形態】**【0014】**

以下に本発明を実施するための最良の形態について、原版がレチクルであり、基板がウエハである場合の実施例を挙げ図1～図9を参照して詳細に説明する。

【実施例1】

10

【0015】

まず、図1～図4を用いて本発明の実施例1に係る露光装置を説明する。ここで、1は、照明系ユニットであり、露光光を光源から導出し、成形均一な露光光とする。2は、レチクルステージであり、露光原版（レチクル）を搭載し、露光光に対して原版（レチクル）をスキャン露光させる。3は、縮小投影レンズであり、原版（レチクル）面に描かれたパターンを、シリコン基板より成るウエハ上に縮小投影する。

【0016】

4は、ウエハステージであり、シリコン基板であるウエハを搭載し、レチクルステージ2と同期して、露光光に対してスキャン移動し露光する。5は、露光装置本体であり、レチクルステージ2及び縮小投影レンズ3、及びウエハステージ4等を支持する。6は、原版レチクルであり、投影パターンが形成されている。7は、レチクルクランプであり、レチクルステージ2上に構成され、レチクル6を吸着保持して位置決めする。8は、スリット露光光であり、レチクル6の原版パターンに対してスリット状の露光光を透過させる。

20

【0017】

以上の構成で、図5に、レチクル6を、レチクルステージ2上のレチクルクランプ7に位置決め保持する構成を示す。その際、レチクルステージ2上に設けられたレチクルアライメント検出手段2Aにより、レチクル6をレチクルステージ2に位置決めする。

【0018】

ここで、図5(1)は、レチクルクランプ7の上面に、レチクル6がクランプ位置決め保持されている状態を示す。

30

図5(2)にクランプ状態を断面図にて示す。

ここで、レチクルクランプ7は、レチクル6をZ方向で位置決めする、第1の原版保持部位であるZ位置決め7Bと、レチクル6に対して弾性的に真空クランプする第2の原版保持部位であるレチクル弾性チャック7Aとが設けられている。

さらに、Z位置決め7Bのピンチャックの外周部を含む周辺部に、Z位置決め7Bのピンチャックに対して、相対的に変位可能に支持された弾性変位可能なレチクル弾性チャック7Aが配置される。レチクル弾性チャック7Aはレチクル面に対して略鉛直方向に弾性変位可能である。第1の原版保持部位であるZ位置決め7Bが複数ある場合において、該複数のZ位置決め7Bの間に第2の原版保持部位であるレチクル弾性チャック7Aを一体的に設けることも可能である。

40

【0019】

レチクル弾性チャック7Aの実装状態を、図6に示す。

レチクル弾性チャック7Aは、レチクル6との当接面に吸着するために、吸引溝7Hおよび部分的にレチクル6に当接する、即ち、真空吸引溝に原版面と部分当接するピン7Fが設けられ、吸引溝7Hに対しては真空吸引する為の真空吸引手段7Dと配管のバキューム孔7Gが設けられている。そして、最終的に図6(2)に示すように、吸引溝7Hを真空状態にすることにより、レチクル6に対してレチクル弾性チャック7Aが吸引クランプする。

【0020】

その際、レチクル弾性チャック7Aは、非吸着時においては、弹性体の為、自重で図6(1)に示すように、非吸着時位置7Cに退避した状態をとっている。吸着時においては

50

、レチクル 6 の下面の吸着クランプ面に吸引移動することにより当接クランプする。

【0021】

図 7 (1) 及び (2) に、レチクル 6 に対する、レチクル弾性チャック 7A のクランプ状態を示す。

レチクル 6 は、Z 位置決め 7B のピンチャックに対して、Z 及び XY 面内の位置決めした後に搭載される。さらに、初期状態であるレチクル 6 へのレチクル弾性チャック 7A の非吸着時には、レチクル弾性チャック 7A は、レチクル 6 に対して、非接触状態で退避位置に位置する。さらに、真空吸引手段 7D により吸引固定される状態では、吸着時に示す様に、レチクル弾性チャック 7A の当接面が、レチクル 6 に弾性変位して当接し、レチクル 6 に対して、吸引溝 7H の真空吸着面により真空吸着保持力を発生させる。

10

【0022】

この際、レチクル 6 の辺に倣う状態で、レチクル弾性チャック 7A が当接することにより、レチクル 6 へのクランプ時の歪の発生を抑える効果がある。

【0023】

また同時に、図 6 (2) に示すように、吸引溝 7H の複数部位に、ピン 7F を設けることにより、レチクル 6 との当接面への異物の付着確率を低減し、異物の付着に起因する歪の発生を抑えることも可能になる。

【実施例 2】

【0024】

本発明の実施例 2 に係るレチクルステージでレチクルをクランプした状態を、図 8 に示す。実施例 1 では、レチクル弾性チャック 7A を、Z 位置決め 7B に対して、片側に構成していたが、本実施例では、図 8 (1) 及び (2) に示すように、Z 位置決め 7B に対して両側に、レチクル弾性チャック 7J を設けることにより、非吸着時位置 7C から 真空吸引手段 7D による真空吸引圧力を、バキューム孔 7G 及びバキューム孔 7K を介して、レチクル弾性チャック 7J に与え、レチクル 6 に対してレチクル弾性チャック 7J を添わせて、吸引クランプする。

20

【実施例 3】

【0025】

本発明の実施例 3 に係るレチクルステージでレチクルをクランプした状態を、図 9 (1) に示す。実施例 1 及び実施例 2 では、レチクル弾性チャックを片側一体構造で構成しているが、本発明は実施例 3 として、図 9 に示す様に、分割体を備えてなる構造にし、各分割体の原版保持面が Z 位置決め 7B に対しそれぞれ独立して変位可能である。

30

【0026】

ここで、レチクル弾性チャック 7L は、Z 位置決め 7B に対してそれぞれ独立して一体支持構成されている為、レチクル 6 に対して独立して添わせることが可能になり、吸着面がレチクル 6 に対してより高い面追従性を得られやすい。

【実施例 4】

【0027】

次に、上述の実施例 1 ~ 3 のいずれかに係る露光装置を利用した半導体デバイスの製造プロセスを説明する。図 13 は半導体デバイスの全体的な製造プロセスのフローを示す図である。ステップ 1 (回路設計) では半導体デバイスの回路設計を行う。ステップ 2 (マスク作製) では設計した回路パターンに基づいてマスクを作製する。

40

【0028】

一方、ステップ 3 (ウエハ製造) ではシリコン等の材料を用いてウエハを製造する。ステップ 4 (ウエハプロセス) は前工程と呼ばれ、上記のマスクとウエハを用いて、上記の露光装置によりリソグラフィ技術を利用してウエハ上に実際の回路を形成する。次のステップ 5 (組み立て) は後工程と呼ばれ、ステップ 4 によって作製されたウエハを用いて半導体チップ化する工程であり、アッセンブリ工程 (ダイシング、ボンディング)、パッケージング工程 (チップ封入) 等の組み立て工程を含む。ステップ 6 (検査) ではステップ 5 で作製された半導体デバイスの動作確認テスト、耐久性テスト等の検査を行う。こうし

50

た工程を経て半導体デバイスが完成し、ステップ7でこれを出荷する。

【0029】

上記ステップ4のウエハプロセスは以下のステップを有する。ウエハの表面を酸化させる酸化ステップ、ウエハ表面に絶縁膜を成膜するCVDステップ、ウエハ上に電極を蒸着によって形成する電極形成ステップ、ウエハにイオンを打ち込むイオン打ち込みステップ、ウエハに感光剤を塗布するレジスト処理ステップ、上記の露光装置によって回路パターンをレジスト処理ステップ後のウエハに転写する露光ステップ、露光ステップで露光したウエハを現像する現像ステップ、現像ステップで現像したレジスト像以外の部分を削り取るエッチャリングステップ、エッチャリングが済んで不要となったレジストを取り除くレジスト剥離ステップ。これらのステップを繰り返し行うことによって、ウエハ上に多重に回路パターンを形成する。
10

【図面の簡単な説明】

【0030】

【図1】本発明の実施例1に係る露光装置を示す概念図である。

【図2】図1のレチクルステージを示す斜視図である。

【図3】図1の要部を示す図である。

【図4】(1)が図3の平面図であり、(2)がその正面図である。

【図5】(1)が図4の要部を示す平面図であり、(2)が(1)のB-B断面図である。
。

【図6】(1)は断面図であり、(2)は平面図である。
20

【図7】(1)は断面図であり、(2)は斜視図である。

【図8】本発明の実施例2に係るレチクルステージを示す図であって、(1)はレチクルステージでレチクルをクランプした状態を示す断面図、(2)はその斜視図ある。

【図9】本発明の実施例3に係るレチクルステージを示す図であって、(1)はレチクルステージでレチクルをクランプした状態を示す断面図、(2)は平面図である。

【図10】従来例を示す露光装置の概念図である。

【図11】(1)は図10の平面図であり、(2)は正面図である。

【図12】(1)は図11の部分平面図であり、(2)はそのA-A断面図である。

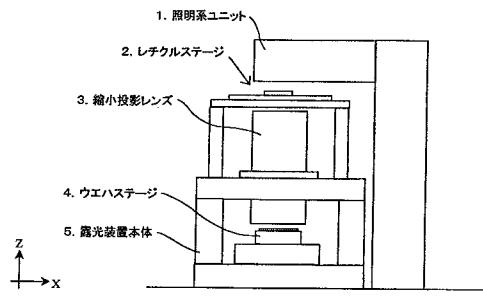
【図13】半導体デバイスの全体的な製造プロセスのフローを示す図である。

【符号の説明】

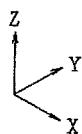
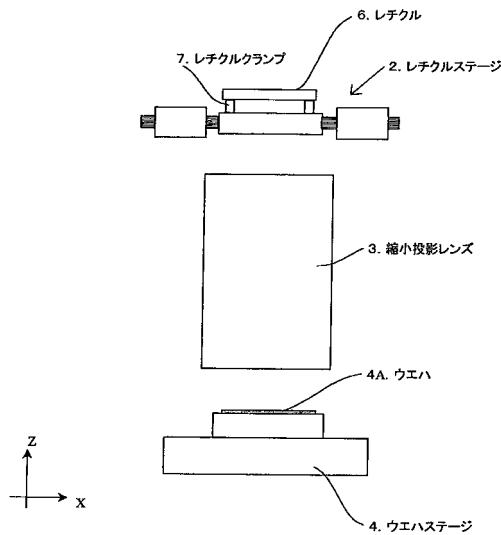
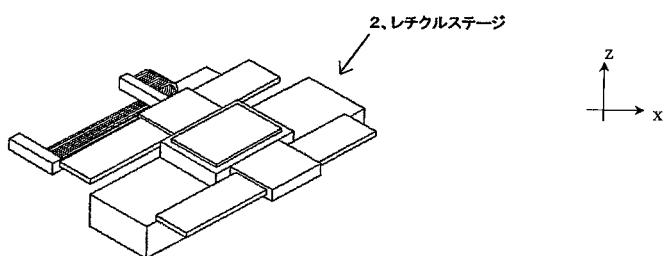
【0031】

1：照明系ユニット、2：レチクルステージ、2A：レチクルアライメント検出手段、
3：縮小投影レンズ、4：ウエハステージ、4A：ウエハ、5：露光装置本体、6：レチクル、
7：レチクルクランプ、7A：レチクル弹性チャック、7B：Z位置決め、7C：
非吸着時位置、7D：バキューム吸引手段、7E：アライメントマーク窓、7F：ピン、
7G：バキューム孔、7H：吸引溝、7J：レチクル弹性チャック、7K：バキューム孔
、7L：レチクル弹性チャック：8：スリット露光光、101：レチクル、101A：ス
リット露光光、102：レチクルステージ、103：レチクルクランプ、103A：レチ
クルクランプパッド、103B：異物、104：縮小投影レンズ、105：ウエハ、10
6：ウエハステージ。
40

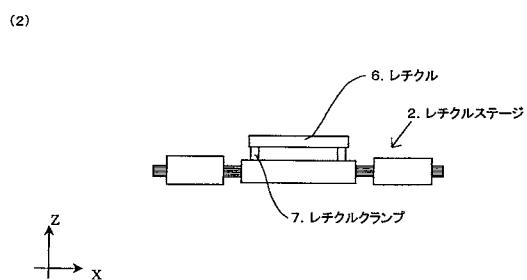
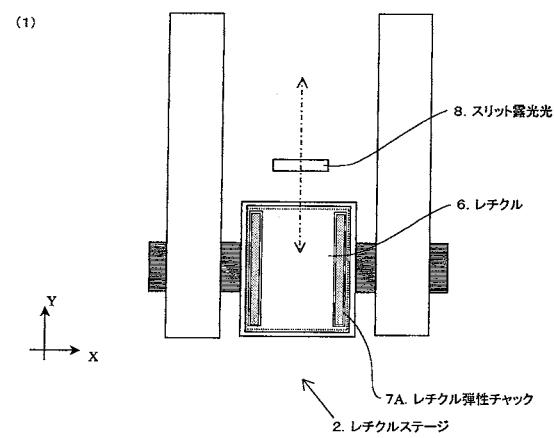
【図1】



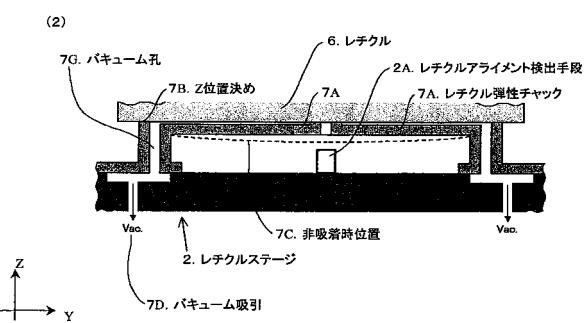
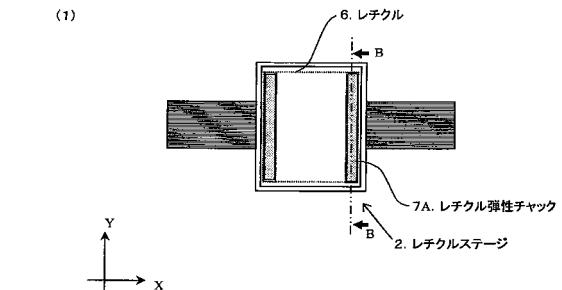
【図2】



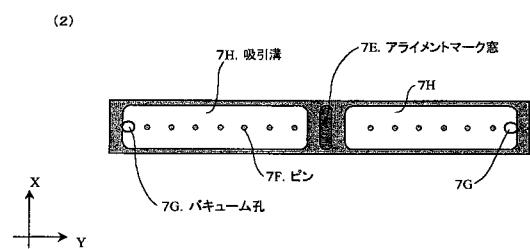
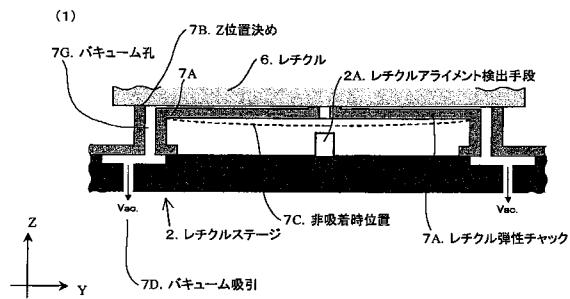
【図4】



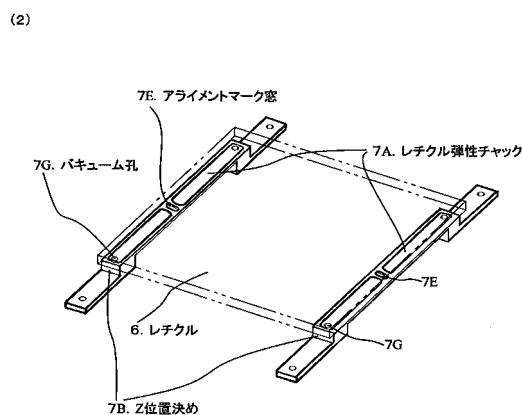
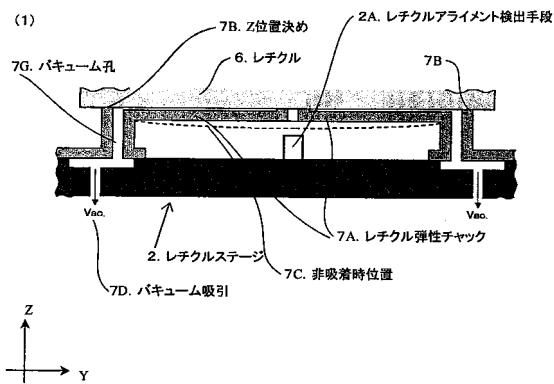
【図5】



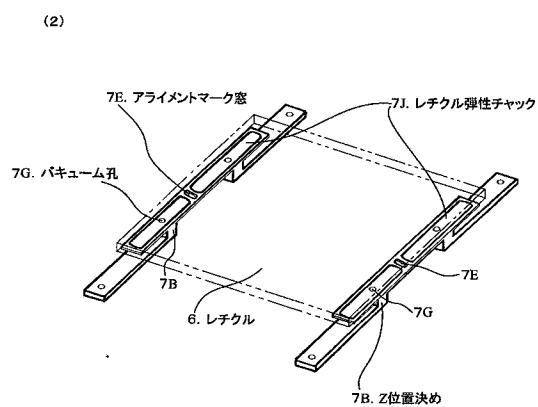
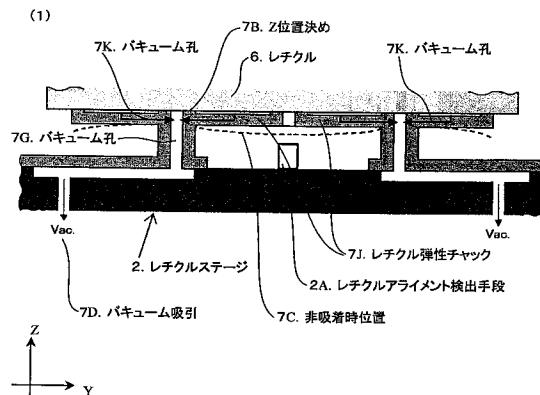
【図6】



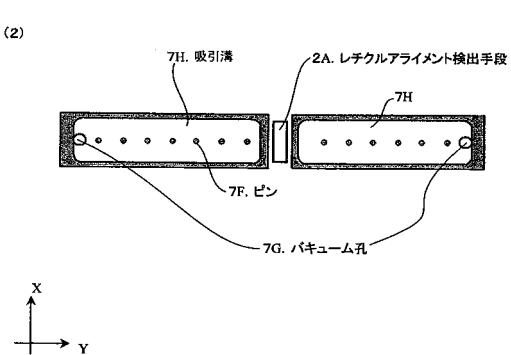
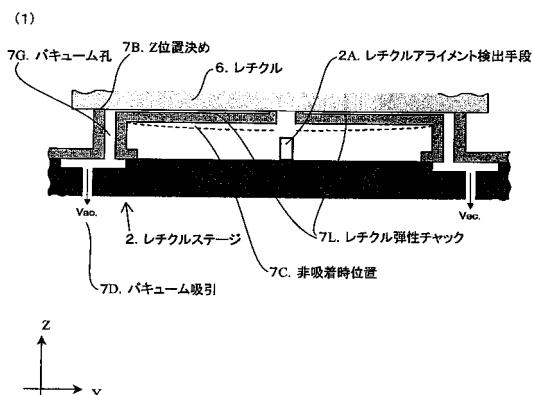
【図7】



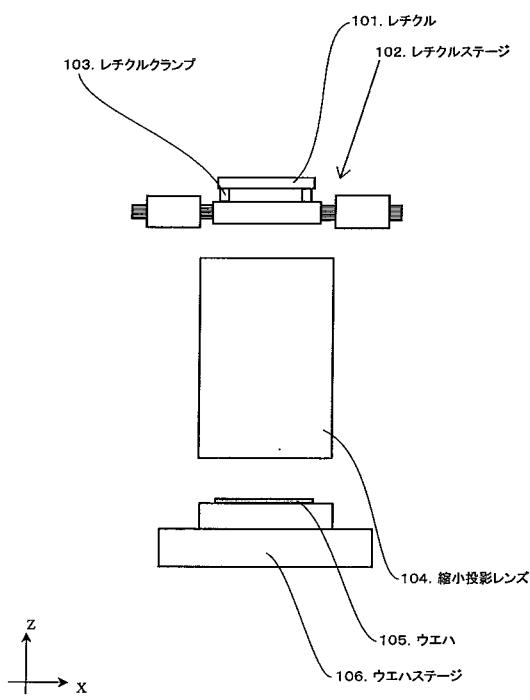
【図8】



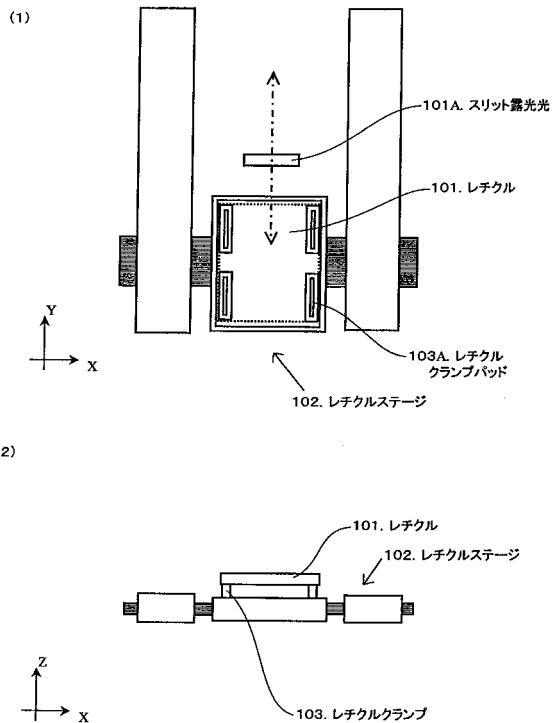
【図9】



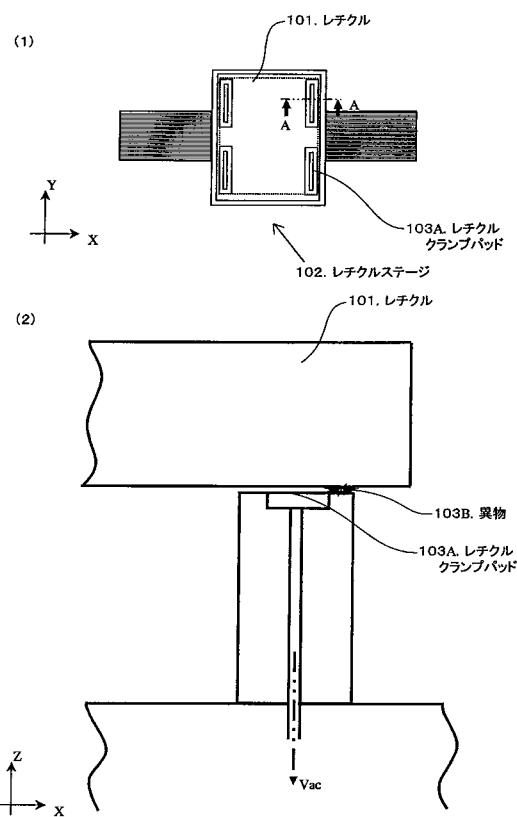
【図10】



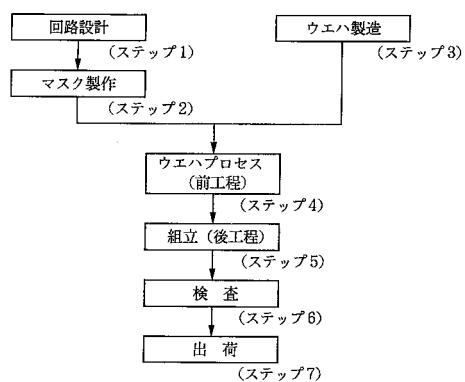
【図11】



【図12】



【図13】



フロントページの続き

(56)参考文献 特開昭62-100753(JP,A)
特開平05-283511(JP,A)
特開平08-195429(JP,A)
国際公開第02/065519(WO,A1)
特開平07-136885(JP,A)
特開2001-332480(JP,A)

(58)調査した分野(Int.Cl., DB名)

H01L 21/027
H01L 21/67-683